МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2024/2025 навчальний рік, прийому студентів 2024 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з навчальної роботи

_____ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
"__" _____ 2024 р.

Спеціальність	174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка	Факультет/ННІ	Приладобудівний факультет
Освітня програма	Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні	Форма здобуття вищої освіти	*Заоч.*
Освітній ступінь	магістра	Строк навчання	1 рік 4 місяці
Випускова кафедра	*Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю*	Кваліфікація	Магістр з автоматизації, комп'ютерно-інтегрованих технологій та робототехніки

№ п/п	Освітні компоненти (навчальні дисц., курс. пр.(роб.), практ., кваліф. роб.)	Кафедра	К-ть здобув.		Обсяг дисциплін		Аудиторні години								СРС	Контрольні заходи								Розподіл аудиторних годин на тиждень за курсами і семестрами							
								Лекції		Практ. (комп. прк)		Лабор												1 курс							
																								ПМ-з41мп (Б: 3, К: 3);							
																								1 семестр				2 семестр			
																								17 тижнів				28 тижнів			
			Бюджет	Контракт	Кред ECTS	Години	Всього	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	за НП	з урах. Інд занять	Інд. зан.		Екзамени	Заліки	МКР	Курсові роботи	Курсові проекти	РГР,РР,ГР	ДКР	Реф.	Всього	у т.ч.			Всього	у т.ч.		
																									Лекц	Практ	Лаб		Лекц	Практ	Лаб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти																															
Цикл загальної підготовки																															
1	*Інтелектуальна власність та патентознавство (модуль Право інтелектуальної власності)*	КІВПП	3	3	1.0	30	4	2	-	2	-	-	-	0	26												4	2	2	
2	*Інтелектуальна власність та патентознавство (модуль Патентознавство та набуття прав)*	КМ	3	3	2.0	60	6	4	-	2	-	-	-	0	54		2	2									6	4	2	
3	*Основи інженерії та технології сталого розвитку*	ШІ	3	3	2.0	60	8	4	-	4	-	-	-	0	52		2	2									8	4	4	
4	*Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації. Частина 1*	АМТС1	3	3	1.5	45	6	-	-	6	-	-	-	0	39			1						6		6					
5	*Практичний курс іноземної мови для ділової комунікації. Частина 2*	АМТС1	3	3	1.5	45	6	-	-	6	-	-	-	0	39		2										6		6		
6	*Розробка стартап-проектів*	ЕК	3	3	3.0	90	10	4	-	6	-	-	-	0	80		1	1						10	4	6					
7	*Основи наукових досліджень*	АСНК	3	3	2.0	60	10	6	-	4	-	-	-	0	50		1	1						10	6	4					
Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки					13	390	50	20	0	30	0	0	0	0	340	0	5	5	0	0	0	0	0	26	10	16	0	24	10	14	0
Цикл професійної підготовки																															
8	*Сучасна теорія управління*	КІОНС	3	3	5.0	150	16	10	-	6	-	-	-	0	134	1		1						16	10	6					
9	*Математичне моделювання процесів та систем*	КІТВП	3	3	4.0	120	16	10	-	6	-	-	-	0	104		1	1						16	10	6					
10	*Робототехніка та інтелектуальні системи*	АСНК	3	3	4.0	120	16	10	-	6	-	-	-	0	104		1	1						16	10	6					
11	*Надійність і діагностика приладів і систем*	АСНК	3	3	4.0	120	12	6	-	6	-	-	-	0	108		1	1			1			12	6	6					
12	*Цифрова обробка сигналів та зображень*	АСНК	3	3	5.0	150	16	10	-	6	-	-	-	0	134	1		1			1			16	10	6					
13	*Комп'ютерний зір*	КІОНС	3	3	4.0	120	8	2	-	4	-	2	-	0	112		1	1						8	2	4	2				
Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки					26	780	84	48	0	34	0	2	0	0	696	2	4	6	0	0	2	0	0	84	48	34	2	0	0	0	0
ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ					39	1170	134	68	0	64	0	2	0	0	1036	2	9	11	0	0	2	0	0	110	58	50	2	24	10	14	0
2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти																															
Вибіркові освітні компоненти з міжфакультетського/факультетського/кафедрального Ф-каталогів																															
14	*Космічні оптико-електронні системи*	КІОНС	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
15	*Військові оптичні та оптико-електронні прилади*	КІОНС	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
16	*Новітні прилади систем орієнтації та навігації*	КІОНС	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
17	*Випробування і контроль приладів і систем*	КІОНС	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
18	*Основи автоматизації технологічних процесів*	АСНК	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
19	*Методи та засоби цифрової обробки сигналів в автоматизованих системах*	АСНК	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
20	*Робототехнічні комплекси в системах неруйнівного контролю*	АСНК	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
21	*Новітні системи та технології обробки сигналів*	АСНК	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
22	*Технології віртуального виробництва*	КІТВП	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
23	*Методи оптимізації процесів і систем*	КІТВП	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
24	*Кріогенна медична техніка*	КІТВП	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
25	*Біометрія*	КІТВП	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
26	*Технології штучного інтелекту мехатронних комплексів контролю та діагностики*	АСНК	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
27	*Перетворювачі руху інтелектуальних мехатронних комплексів контролю та діагностики*	АСНК	0	0	4.0	120	22	10	-	12	-	-	-	0	98		2	2									22	10	12	
28	*Перетворення сигналів в оптико-електронних системах*	КІОНС	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
29	*Основи інженерного експерименту*	АСНК	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
30	*Навігаційні системи*	КІОНС	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
31	*Сучасні оптичні технології та системи*	АСНК	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
32	*Мікроконтролери в системах неруйнівного контролю*	АСНК	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
33	*Прилади та багатоканальні системи акустичного неруйнівного контролю*	АСНК	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
34	*Автоматизована розробка керуючих програм*	КІТВП	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
35	*Моделювання параметрів автоматизованих систем*	КІТВП	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
36	*Діагностика засобів автоматизації технологічних процесів*	КІТВП	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
37	*Аналіз вимірювальних сигналів*	КІТВП	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
38	*Генезис біосигналів*	КІТВП	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
39	*Біофотоніка* ‡	КІТВП	0	0	5.0	150	22	10	-	-	-	12	-	0	128	2		2									22	10		12
40	*Інформаційно-вимірювальні технології в галузі енергозбереження*	АСНК	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
41	*Моделювання процесів і систем в енергозбереженні*	АСНК	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
42	*Інтегровані технології оцінки відповідності вимірювальних приладів і систем у енергозбереженні*	АСНК	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
43	*Комп'ютеризовані системи керування рухомими об'єктами*	КІОНС	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
44	*Автоматичні системи орієнтації і стабілізації*	КІОНС	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
45	*Проєктування оптичних систем*	КІОНС	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
46	*Тепловізійні оптико-електронні прилади*	КІОНС	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
47	*Інтелектуальні прецизійні мехатронні комплекси вимірювання параметрів*	АСНК	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
48	*Вимірювальні перетворювачі та виконавчі пристрої мехатронних комплексів*	АСНК	0	0	5.0	150	22	10	-	12	-	-	-	0	128	2		2									22	10	12	
Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки					23	690	110	50	0	60	0	0	0	0	580	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	50	60	0
ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ					23	690	110	50	0	60	0	0	0	0	580	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	50	60	0
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ:					62	1860	244	118	0	124	0	2	0	0	1616	5	11	16	0	0	2	0	0	110	58	50	2	134	60	74	0

Кількість	Кількість екзаменів	5	2				3			
	Кількість заліків	11		6				5		
	МКР	16			9				7	
	Курсових робіт	0								
	Курсових проєктів	0								
	РГР, РР, ГР	2		2						
	ДКР	0								
	Рефератів	0								

‡ Виконано перерозподіл аудиторних годин

* МКР виконується за методикою домашньої контрольної роботи

Ухвалено на засіданні Вченої ради ПБФ ПРОТОКОЛ № 5/24 від 2024-05-27

Завідувач кафедри АСНК _____ Юрій КИРИЧУК
(підпис)

Декан факультету (директор інституту) _____ Григорій ТИМЧИК
(підпис)

Примітка: РНП є частиною навчального плану і формується на основі аналізу сукупності індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік;